(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公表特許公報 (A)

(11)特許出願公表番号 特表2000-516720 (P2000-516720A)

(43)公表日 平成12年12月12日(2000.12.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I	テーマコード(参考)
G01D	5/14		G 0 1 D 5/14	Н
G01B	7/00		G01B 7/00	J .

審査請求 未請求 (全 29 頁)

	VILLE I WAS A WAR A STATE OF THE STATE OF TH
(86) (22)出顧日 平成9年8月9日(1997.8.9) (85)翻訳文提出日 平成11年2月19日(1999.2.19) (86)国際出顧番号 PCT/EP97/04347 (87)国際公開番号 WO98/08061 (87)国際公開日 平成10年2月26日(1998.2.26) (31)優先権主張番号 19634074.8)出願人 マンネスマン ファウ デー オー アク チエンゲゼルシャフト ドイツ連邦共和国 フランクフルト アム マイン クルップシュトラーセ 105)発明者 ペーター ヴィーゼ ドイツ連邦共和国 ケーニッヒシュタイン フォルダーシュトラーセ 11アー)代理人 弁理士 矢野 敏雄 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁気位置センサ

(57)【要約】

本発明は、少なくとも2つの固定子要素が磁界に配置さ れ、磁界プロープが固定子要素の間の空隙に位置決めさ れ、かつ、物体の運動を追跡する手段が前記固定子要素 の間に広がる平面に平行に配置される、磁気位置センサ に関する。軸方向の遊びとは関係しない位置センサの場 合、可動物体に接続される手段は、2部設計から成り、 各軟磁性部分 (4a、4b) は少なくとも1つのセグメン トを有し、かつ、軟磁性要素が相互に対して移動する方 法で相互に堅実に接続されているために、第1の要素 (4a) が第2の要素 (4b) のセグメント間隙に対向し て位置決めされ、固定子要素(2a、2b)が軟磁性要素 (4a、4b) の間に配置され、固定子要素 (2a、2b) の間に広がる垂直な磁界を発生する磁石 (3) が、固定 子要素 (2a、2b) の間と軟磁性要素 (4a、4b) の間 の両方に配置される。

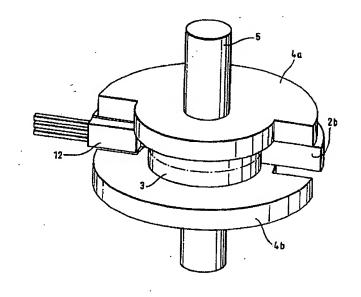


Fig. 3

【特許請求の範囲】

1. 少なくとも2つの固定子要素が磁界に配置され、磁界プローブが前記固定子要素の間の空隙に位置決めされ、物体の運動を追跡する手段が前記固定子要素の間に広がる平面に平行に配置される磁気位置センサにおいて、可動物体に接続される前記手段が2つの軟磁性要素(4a、4b;20a、20b)を含み、各軟磁性要素(4a、4b;20a、20b)が加なくとも1つのセグメント(4a1、4a2;23)を有し、かつ、前記軟磁性要素(4a、4b;20a、20b)が相互に対して移動する方法で相互に整実に接続されるために、第1の要素(4a;20a)のセグメント(4a1、4a2;23)が、第2の要素(4b;20b)のセグメント間隙に対向して位置決めされ、前記固定子要素(2a、2b;21a、21b)が前記軟磁性要素(4a、4b;20a、20b)の間に配置され、かつ、前記固定子要素(2a、2b;21a、21b)の間に広がる平面に垂直な磁界を発生する磁石(3)が前記軟磁性要素(4a、4b;20a、20b)の間に配置される、磁気位置センサ。

2. 前記可動物体に接続される前記手段が、前記固定子要素 (2a、2b) に対して軸方向に配置され、各軟磁性回転子要素 (4a、4b) が少なくとも1つの円形セグメントを有し、かつ、前記回転子要素が相

互に対して回転する方法で相互に堅実に接続されているために、第1の回転要素 (4a) の前記円形セグメントが、第2の回転要素 (4b) のセグメント間隙に対向して配置され、前記固定子要素 (2a、2b) が前記回転子要素 (4a、4b) の同に配置され、かつ、軸方向に磁界を生成する磁石が、回転子要素 (4a、4b) と固定子要素 (2a、2b) の間に配置される、請求の範囲第1項に記載の磁気位置センサ。

- 3. 前記回転子要素 (4a、4b) とそれぞれの固定子要素 (2a、2b) の間の軸 方向に形成される前記2つの空隙 (15、16) の合計が、前記磁石 (3) の軸 方向の範囲と比較して小さい、請求の範囲第2項に記載の磁気位置センサ。
- 4. 前記固定子要素 (2a、2b) が、円形セグメント模設計から成る、請求の範囲第2項に記載の磁気位置センサ。
- 14. 前記輸型磁石 (3) が、前記2つの固定子要素 (2a、2b) に直接接続される、請求の範囲第13項に記載の磁気位置センサ。
- 15. 前記輪型磁石(3)が、前記回転子シャフト(5)に締結される、請求の範囲第13項に記載の磁気位置センサ。
- 16. 前記回転子要素 (4a、4b) が非磁性スリーブ (8) によって堅実に連結され、各々の回転子要素 (4a、4b) が前記回転子シャフト (5) の一部に固定配置され、それが2つに分割される、請求の範囲第2項または第6項に記載の磁気位置センサ。
- 17. 前記固定子要素 (2a、2b) が、前記回転子シャフト (5) の回転軸の周囲 に同軸配置される、請求の範囲第4項乃至第7項に記載の磁気位置センサ。
- 18. 磁石(3))と磁界プローブ(1 2)の高さを等しくするために、高い軟磁性領域(1 7)が、回転子要素(4 a、4 b)上に配置される、前述の請求の範囲のいずれかに記載の磁気位置センサ。

- 5. 少なくとも1つの回転子要素(4a、4b)の前配円形要素(4a1、4a2; 4b1、4b2)の外半径(R1)が、前配円形セグメント様固定子要素(2a、 2b)にほぼ対応する、請求の範囲第2項および第4項に配載の磁気位置センサ
- 6. 前記回転子要素 (4a、4b) が2つの半径 (R1、R2)、すなわち、固定子要素 (2a、2b) の外半径にほぼ対応する第1の半径 (R1) と、前記磁石 (3) の半径にほぼ対応する第2の半径 (R2) とを特徴

とする、請求の範囲第5項に記載の磁気位置センサ。

7. 磁界プローブ(12)が、前記センサの回転スピンドル(5)に対して2つの 固定子要素(2a、2b)の間の空隙(11)に半径方向に配置される、請求の範 囲第6項に記載の磁気位置センサ。

- 8. 少なくとも1つの回転子要素 (4a、4b) の前配円形セグメント (4a1、4a2;4b1、4b2) の前配外半径 (R1) が、固定子要素 (2a、2b) の外半径よりも小さい、請求の範囲第2項および第4項に記載の磁気位置センサ。
- 9. 前記磁界プローブ(12)が、前記センサの前記回転スピンドル (5) に対して、2つの固定子要素 (2a、2b) の間の空隙 (11) に軸方向に配置される、請求の範囲第8項に記載の磁気位置センサ。
- 10. 前記第1の回転子要案(4a)の前記円形セグメント(4a1、4a2)が、 2つの固定子セグメント(2a1、2a2;2b1、2b2)の間のセグメント間隙 よりも小さい角度を有する、請求の範囲第2項に記載の磁気位置センサ。
- 11. 軸方向の磁界を発生する前記磁石 (3) が位置的に固定された電磁石である 、請求の範囲第1項または第2項記載の磁気位置センサ。
- 12. 軸方向の磁界を発生する前期磁石 (3) が、永久磁石と電磁石の組み合わせから成る、請求の範囲第

1項または第2項に記載の磁気位置センサ。

13. 前記磁石 (3) が永久磁石性の輪型磁石として設計される、請求の範囲第1項または第2項に記載の磁気位置センサ。

【発明の詳細な説明】

磁気位置センサ

本発明は、少なくとも2つの固定子要素が磁界に配置され、磁界プローブがそれらの固定子要素間の空隙に位置決めされ、物体の運動を追跡する手段が、それらの固定子要素の間に広がる平面に平行に配置される磁気位置センサに関する。

WO 92/10722号には、角度比例信号を出力することができるホール効果 角度センサが開示されている。角度は、2つの対称的な固定子部分またはシェル 形状の固定子部分の間に形成される空隙内に位置決めされるホールプローブによって、求められる。

回転子は、交互の方向に磁化され、かつ、戻り経路ディスク上に取り付けられる2つのディスク型磁石を含む。回転子は、2つの固定子部分の前に軸方向に位置決めされる。この場合、磁石の磁化方向は、回転軸に垂直である。

ディスク型磁石の北極から発生する磁束は、それが磁石の南極に入る前に、磁 石部分に対する固定部分の角度位置によって異なって分布する。

磁石の南極/北極軸が空隙に平行である場合、約半分の磁束が、2つの固定子部分各々を通じて流れる。実質的には、この場合には、磁束は空隙を全く通過しな

い。測定誘導値は、0になる傾向がある。

磁石の北極/南極軸が空隙に垂直である場合には、実質的にすべての磁束が最初に一方の固定子部分に入り、空隙と交差して、もう一方の固定部分に入って、そこから、磁石の南極に入る。結果的に、ホールプローブは、測定誘導最大値を記録する。

磁束は、測定空隙の他に、軸方向に磁石と固定子の間の空隙を2度横切る経路をたどるので、例えば、機械的軸方向の遊びなどの形態のこの空隙の変動によって、測定値が大きく変わってしまう。

従って、本発明は、測定方向以外の方向では、可動手段の変位に鈍感な磁気位 電センサを規定するという目的に基づくものである。

本発明によれば、本発明の目的は、可動物体に接続される手段は、2部設計で

構成され、各軟磁性部品が少なくとも1つのセグメントを有し、それらの軟磁性 要素が相互に対して転置する方法で相互に緊寒に接続され、第1の要素のセグメ ントが第2の要素のセグメント間隙に対向しているために、固定要素が軟磁性要 素の間に配置され、固定子の間に広がる平面に垂直な磁界を発生する磁石が軟磁 性要素の間に配置される。という事実によって遠成される。

可動物体に接続される手段のこの対称的な構造によって、測定空隙を経由する 補償磁束が発生する。

改良した殷様では、可動物体に接続される手段は、

固定子要素に対して軸方向に配置される回転子である。

この回転子は、2部設計で構成され、各軟磁性回転子要素は少なくとも1つの 円形セグメントを有し、回転子は相互に対して回転する方法で相互に堅実に接続 されているため、第1の回転子要素の円形セグメントが第2の回転子要素のセグ メント間隙に対向して位置決めされ、回転子要素が固定子要素の間に配置され、 軸方向に磁界を発生する磁石が回転子要素と固定子要素の両方の間に配置される

本発明の利益は、固定子と回転子の間に生じる2つの空隙は、反対方向に同時に変化し、結果的に、全体の空隙が常に一定であるので、緊要な2部回転子構成によって軸方向の遊びがセンサ信号に影響することを防止することにある。

利益的な方法では、回転子要素と各々の固定子要素の間に軸方向に形成される 全体の空隙は、磁石の軸方向の範囲と比較して小さく、その結果として、固定子 を通過する磁束が維持される。

改良された態様では、固定子要素は、円形セグメント機設計と同様である。 少なくとも1つの回転子要素の円形セグメントの外半径は、この円形セグメント ト様固定子要素の外半径に対応する。回転子要素は、2つの半径、すなわち、固 定子要素の外半径にほぼ対応する第1の半径と、磁石

の半径にほぼ対応する第2の半径とを特徴とする。

この場合、磁界プローブは、2つの固定子要素の間の空隙のセンサの回転スピ

本発明では、多数の実施態様が可能である。この1つについて、図面に図示される各図を参考に、より詳細に説明する。

各図において、

図1は、本発明による第1の設計の角度センサを示すハウジングおよび固定子 を通る断面図である。

図2は、第1の設計の回転子を示す図である。

図3は、回転子-固定子集成装置を示す図である。

図4は、本発明による第2の設計の角度センサを示す図である。

図5は、回転軸に垂直な回転子-固定子集成装置を示す図である。

図6は、第2の設計の回転子固定子集成装置を示す図である。

図7は、回転角に対する信号分布を示す図である。

図8は、第3の設計の回転子-固定子集成装置を示す図である。

図9は、第4の設計の回転子--固定子集成装置を示す図である。

図10は、キャリヤー要素上の角度センサを含む集成装置を示す図である。

図11は、線形磁気位置センサの基礎構造を示す図である。

図12は、線形磁気位置センサを通る断面図である。

尚、一致する部分には、一致する参照符号を付した。

まず、基礎的な原理について、2つの半円形回転子セグメントを有する回転子 構成を用いて説明する。この配置は、例えば、内燃エンジンの絞り弁などで、9 0度の回転角を得ようとした場合に好都合な用途である。

図1は、2つに分割される軟鉄リングを、非磁性費.

鋼ハウジング1の材料接合部によって接続する方法で、固定子部分2a、2bを有する固定子として配置したものである。好ましいシェル形状固定部分2a、2bは、一緒であるとみなしたときには中空円筒固定子を構成し、永久磁石3の周囲に同軸に配置される。この場合には、磁石3は軸方向に磁化される。

磁石3は、相互に対して180度まで回転される軟磁性材料から成る2つの回転子ディスク4a、4bの間に位置決めされる。

ンドルに対して半径方向に配置される。

発展させた態様では、少なくとも1つの回転子要素の円形セグメントの外半径は、固定子要素の外半径よりも小さい。これによって、磁界プローブ、2つ固定子要素の間の空隙にセンサのシャフトの回転軸に対して軸方向に配置することができる。そこで、この配置による利益は、2つの回転子部分の間の軸方向の間隔を自由に変更することができるので、磁石を最適に寸法決定することができることにある。

センサ全体のアセンブリの単純化は、第1の回転子要素の円形セグメントが2 つの固定子セグメント間のセグメント間隙よりも小さい角度を有する場合に、違 成される。

回転子ディスクが非対称的な構成であれば、磁束が2つの固定子部分経由で的 確な方法で誘導される。

磁束誘導の角度依存性は、磁石の輪郭または磁化によって達成されるのではなく、回転子の輪郭が非対称的な構成であることによって達成されるので、磁石に対する必要条件は、最低限である。

磁石は、軸方向に向かう磁界を発生しなければならないだけである。この磁界 を、回転可能に取付けられた永久磁石または固定子に対して位置的に固定される

磁石によって発生することができる。尚、後者の磁石は、永久磁石または電磁石 のいずれかとして設計することができる。

発展させた態様では、磁石は、永久磁石性の輪型磁石である。

この輪型磁石は、位置的に固定した2つの固定子に直接接続される場合には、 センサに特に単純な方法で取付けることができる。

別の改良された態様では、磁石を、連続回転子シャフトに嵌合させることによって、そのシャフトに締結する。

他の設計では、2つの回転子ディスクは、非磁性スリーブによって堅実に連結され、各回転子ディスクは回転子シャフトの一部に固定して配置され、固定子シャフトは2つに区分される。

この場合、固定子要素は、回転子シャフトの回転軸周囲に同軸に配置される。

この場合には、各回転部分 4 a、 4 bは、ディスクの 1 8 0 度を覆う第 1 の外半径と、ディスクの残りの 1 8 0 度を覆う第 2 の外半径とを特徴とする。大きい外半径R 1 は、固定子の外側半径に対応し、小さい外半径R 2 は、磁石の直径と同等である(図 2)。この場合には、R 1 > R 2 であるので、各回転子セグメントは、本質的に半円形の外観を呈する。

各回転子部分4a、4bは、中心孔9を有し、連続回転子シャフト5を受容する。この場合、回転子部分4a、4bは、連続回転子シャフト5に適所に固定ロックされる。回転子シャフト5は、非磁性材料から成る。

あるいは、回転子部分4a、4bを、回転子シャフト5の一部として設計してもよい。

この場合には、回転子シャフト5は、回転子セグメント4a、4bと同じ磁性材料から成る。この場合には、監視すべきシャフトの機械的カップリングは、非磁

気的に達成される。

利益的な方法では、磁石3は、輪型磁石として中空円筒状に同様に設計されて、回転子シャフト5に締結される。

同様の中空円筒ハウジング1は、回転子シャフトが取付けられる被覆 6 および 7 によって両端で閉じられる。

磁界プローブ12は、ホールプローブまたはその他の磁界プローブ(誘導装置)などであり、ハウジング1の開口部10を通じて空隙11に導入され、空隙11は、その開口部10の後方で2つの固定子部分2a、2bの間に位置する。

これについては、図3でもう一度概略的に図示する。ホール効果センサ12を 見えるようにするために、第2の固定子部分2aは、図示されていない。これは 、ホール効果センサ12の前方に位置決めされる。

図4によれば、磁石3は、円筒状または平行六面体状の設計から成り、非磁性 スリーブ8に収容される。磁石3は、スリーブ8に接着してもよい。

目下の場合には、回転子シャフト5は、2部設計で構成される。回転子ディスク4a、4bは、回転子シャフト5a、5bの各部分に締結される。スリーブ8は、回転子ディスク4a、4bのフライス削り部分13a、13bに係合しているので、

回転子シャフトの5a、5bの2つの部分を相互に堅実に接続する。

。さらに、スリーブ8は、締付ピン14によって固定される。

磁石3とホールプローブ12の高さを等しくするために、浮き出した軟磁性領 域17を回転子ディスク4a、4b上に位置決めする(図2)。

固定子2a、2bは、2つの回転子部分の間に位置決めされる。2つの固定子部 分2a、2bは、優秀な透磁率を有する。さらに、回転子と固定子の間に軸方向に 形成される2つの空隙15、16の合計は、磁石3の長さよりも狭い。これによ って達成される効果は、大部分の磁束が2つの固定子部分を通過して流れること である。

特定の態様では、サマリウムコバルトを磁性材料として使用する。磁石3が3 mm軸方向に延在している場合には、回転子ディスク4a、4bと固定子部分2a、 2bの間の空隙 15、16は、ほぼ 0.5mmである。

次に、上述の角度センサの配向方法を、図5を参照して説明する。理解しやす くするために、センサ4上に4分円を配置した。

原則的に、磁石の北極から発生する磁束は、第1の固定子部分に入る。より少 ない部分は、磁石の南極の方向に空隙を通って漏れ磁束として集まり、第2の回 転子部分に入ってから、南極に至る。

最初は、回転子は、図 5 aに示されるように配向される。断面線(半円形ディ スク4a、4bの「弦」)は、

測定空隙11に垂直である。この位置では、各場合に、第1の4分円の約半分の 有用な磁束が上部回転子ハーフディスク4aから発生し、右側固定子部分2aを 通って第4の4分円に流れ、下部回転子ハーフディスク4bに入る。残りの半分 の磁束は、第2の4分円の上部回転子ハーフディスクから発生し、左側の固定子 部分2bを通って第3の4分円に流れて、下部回転子ハーフディスク4bに入る。

測定空隙11の誘導は0になる傾向がある。磁束は、空隙を横断しないので、 回路全体の磁気抵抗は最低限になり、その結果、最大の磁束が生じる。従って、 回転子4a、4bは、好ましくは外部の力の影響を一切受けずにこの位置を占める

例えば、自動車の加速ペダルに必要であるような30度以下の回転角を検出し ようとした場合、例えば、狭い測定領域に対して信号の振幅を増加しなければな

図6に示す種類の回転子配置は、この目的のために選ばれるものである。回転 子要素4aおよび4bは、ここでは、各場合に互いに対して自己の有する幅だけ偏 り、かつ、回転の中心方向に磁気的に連列される整数のセグメントを含むように 設計されている。

このような回転子要素 4 a、 4 bは、相互に堅実に連結もされる。

最も単純な場合には、各回転子要素は、相互に対向して配置される2つのセグ メントを有する。第1の回転子要素4aは、相互に対して180度だけ移動され るセグメント4a1、4a2を有し、第2の回転子要素4bは、同様に2つのセグ メント4b1および4b2を有する。2つの回転子要素4a、4bは、回転子要素4 bの間隙が回転子要素 4 aのセグメント 4 a 1 に対向して配置されるように、相互 に対して偏っている。同じことを、第2の回転子要素4bのセグメント4b1、4 b2に適用すると、第1の回転子要素 4 aのセグメント間隙は、それらのセグメン トに常に対向して位置決めされる。回転子要素 4 aおよび 4 bのそれぞれの 2 つの セグメント 4 a 1 、 4 a 2 および 4 b 1 、 4 b 2 の間の距離は、ここでは、各場合に ついてセグメント間隙と呼ぶ。

あるいは、回転子要素 4 a、 4 bがNセグメントを有することが考えられる。そ の場合には、回転子要素は、それらが相互に対して180度/Nだけ偏るように配 置される。すでに説明した通り、各ブレードの幅は、180度/Nに一致する。そ の結果、信号周期は、半円形の変更態様と比較して 1 /Nだけ短かくなる。

図7は、回転角の関数としての信号分布を示す図である。この場合には、曲線 Aは、図6に従って図示された種類の回転子配置に対する測定空隙の磁束分布を 示す。180度の周期は、2つのセグメントによって達成される。

半円形回転子配置に対する信号分布は、曲線Bによって表示される。360度 の周期は、この単一セグメント配置によって達成される。

ことになる。

同じ条件は、回転子がさらに180度回転させるまで生じる。

次のステップでは、図5bに示すように、回転子をさらに90度まで、数学的 に正の方向に回転させる。その結果として、北極に接続される回転子ハーフディ スク4aは、左側の固定子部分2b上方に位置決めされる。南極に接続される回転 子ハーフディスク4bは、右側固定子部分2a上方に位置する。

実際には、第2および第3の4分円上に均一に分布するすべての磁束が、左側 ハーフディスク 4 a(北極)から左側固定子部分 2 bに渡り、空隙 1 1 と交差して から、第1および第4の4分円の領域の右側回転子ハー

フディスク4b(菌板)に入る。

このため、測定空隙11の誘導は最大値を有する。磁束は、空隙と交差するの で、回路全体の磁気抵抗が最大限になり、その結果、最小限の磁束が発生する。 不安定な無力位置が生じる。最大復元モーメントは、この位置の左および右に生 じる。

同じ条件は、さらに180度回転させるまで生じる。この場合には、測定空隙 11を通過する磁束の合計は、逆転する。

出力信号は、360度の周期があるため、180度の範囲までは明白である。 さらに、出力倡号は、120度の領域ではほぼ線形である。冗長僧母が必要とさ れる用途では、固定子要素 2 a、 2 bの間の空隙 1 1 内に第 2 のセンサを配置する ことができる。

固定子の外面は、高透磁率のために、等電位面を構成するので、空隙 1 1 の線 形領域の誘導はすべての位置で同じ大きさである。これによって、2つのチャネ ル間で非常に十分に一致するために、例えば、2 つのチャネルの1 つの誤動作を 非常に早く検出することができる。

上述の角度センサの場合には、空回転子ハーフディスク4a、4bと固定子部分 2a、2bの間の両側に軸方向に存在する空隙の合計は、常に一定のままである。

この結果、測定信号に対する軸方向の遊びの影響は、非常に十分に抑制される

効面積は、比率的には1:2である。空隙の数は、2Nである。

図6に示す装置は、相互に並んで配置され、かつ、互いに180度の領域を成 す2つの90度セグメントを含む固定子集成装置である。固定子セグメント2a 、2bは、回転子要素4a、4bの間に配置され、かつ、相互に対してホールプロ ーブ12がシャフト5に対して半径方向に配置される空隙を形成する。

冗長装置8を図8に示す。90度セグメントとして設計される2つの固定要素 2a1、2b1および2b2、

2a2は、各場合について、測定空隙11を形成し、そのそれぞれについて、磁 気プローブ12が配置される。この設計では、固定子セグメント2a1、2a2、 2b1、2b2は、回転子セグメント4a1、4a2、4b1、4b2よりも大きな外 半径を有する。この場合、磁気プローブ12は、90度まで回転させて配置して もよい。すなわち、センサの回転方向に対して軸方向に、測定空隙11に配置し てもよい。両方の磁界プローブを一方とこの設計のための間じプリント基板に配 置することができる。

ここで、2つの回転子要素 4 a、 4 bの間の軸方向間隔を自由に選択することが できるので、磁石3を最適に寸法決定することができる。

この点まで考慮した集成装置では、信号周期は測定領域に適合する。

回転子および固定子をNで整数に分割することを、この目的のために行った。 整数に分割されなかった場合には、結果は、勾配が0度を有する領域または36 0度までの完全回転内で2倍の勾配を有する領域となった。

ただし、回転子および固定子の非整数分割は、限定された角度範囲を利用する 用途でも考えられる。

図9は、57度のセグメント化を実施して、冗長個号が生成される例を示す図 である。

この目的のために、4つの回転子要素2a1、2b1

、2a2、2b2を設けて、その各場合に、2つの固定子セグメント2a1、2b1 磁束が結合される回転子集成装置 4 a、 4 bおよび固定子集成装置 2 a、 2 bの有 および 2 a 2 、 2 b 2 を互いにほぼ平行に隣接させた。この場合の 6 6 度の開放領 域は、例えば、上述の2つの固定子対2a1、2b1;2a2、2b2の間に生じる。

回転子要素4aは、単一の固定子幅(57度)の2つのセグメント4a1、4a 2を有する。回転子要素4bは、相補的な構造を有する。すなわち、間隙は回転 子要素4aの円形セグメント4a1、4a2の幅に対応する範囲を有する。

回転子スタック4a、4bを、図示の位置に対して土90度に対応する適切な位置に導入した場合、それを全体的に軸方向に接合したり取り外したりすることができる。

これで、固定子および電子装置を有する固定子側(プリント基板17)と、それと同等に、回転子側(回転子要素4a、4b、磁石3、シャフト5)を予め組立られたユニットとして処理することができるので、これによって、組立をかなり単純にすることが可能である。

例えば、回転子側をプラスチックから成る非磁性体に予め取付けてから、シャフト5にプレスしてもよい。プラスチック体によって、シャフト5の磁気波結合が可能になる。尚、シャフト5は、軟磁性材料から成ってもよい。さらに、シャフトに層を設ける必要はも

はやないので、かなりの単純化が図れる。

図10は、プリント基板上のセンサ配置を示す図である。説明を簡単にするために、この場合には、回転子要素は図1の実施例による半円形構成を有するように選択されている。図10aは、プリント基板17を示す平面図を示し、図10bは、それに対応する断面図を示す図である。

回転子要素 4 a、4 bは、非磁性の2つの層を設けたシャフト5 にプレスされている。固定子セグメント2 a、2 bは、プリント基板上の中空リベット18 およびディスク19 によって、孔20を介して締結されており、それらは、固定子セグメント2 a、2 bと、できれば、さらに、信号調節用の構成要素の間に配置される(参照:断面8-B)。

平面図からわかるように、固定子要素2a、2bの孔20は、外側の固定子半径 R1の外側に位置する。センサ特性曲線のさらなる線形化は、半径の角度依存構

、固定子要素 2 1 a、 2 1 bの間の空隙に配置される。

センサの線形測定範囲は、第1の滑動要素20aのセグメント23の有効長さにちょうど対応する。これは、センサが少なくとも測定範囲よりも3倍長いことを意味する。

上述の線形センサは、例えば、自動車の加速ペダルの位置を求めるために使用することができる。このためには、センサを加速ペダルリンク19を介してそれに接続する。復元ばねへのリンクは、装置30によって達成される。尚、装置30は、センサに、好ましくは、第2の滑動要素20b上に、単純な方法でリベット26で補助をして配置される。

成によって達成することができる。

この場合も、図1から明らかなように、磁石3は、シャフト5の周囲の輪型磁石として設計されており、その磁石は、軸方向に磁化されており、2つの回転ディスク4a、4bの間のシャフト5に直接位置決めされる。

本発明による位置センサは、図11の線形センサとして図示されている。

この線形センサは、2つの可動軟磁性滑動要素20aおよび20bを有する。滑動要素20aは、矩形セグメント23を有し、その磁気有効面積Fは、それが第2の滑動要素20bの同様の矩形セグメント間隙24に正確に適合するように寸法決定される。

磁石レセプタクル22は、第1の滑動要素20aに取付けられる。磁石レセプタクル22を第1の滑動要素20aを用いて組立てた場合に、磁石3が第1の要素20aの有効面積Fの外側に配置されるように、この磁石レセプタクル22は、平行六面体磁石3を支持する。

図12に示すように、磁石レセプタクル22は、磁石3に接続されており、かつ、2つの滑動要素20aおよび20bにリベット接続(開口部25およびリベット26)によって接続されて、2つの滑動要素20aおよび20bの間のスペーサーとしても同時に役立つ。

固定子要素21aおよび21bは、プリント基板(詳細には図示せず)に締結されており、2つの固定子要素21aおよび21bの間の空隙20aが第1の滑動要素20aの有効面積Fによって部分的に被覆されて、固定子要素21a、21bが第2の滑動要素20bの付近に空間的に配置されるように、滑動要素20aおよび20bと磁石レセプタクルも含む予め組立られたユニットに押し込まれる。

第1の滑動要素20aのセグメント23が、センサの

中央線Mに対して対称的である場合、固定子要素21aと21bの間の測定空隙2 8を通過する補償磁束は発生しない。滑動要素20aが、この位置からy方向に 移動した場合には、固定子要素21aと21bの間の測定空隙28を通過する補償 磁束が生じて、磁界プローブ12によって記録される。尚、磁界プローブ12は

【図1】

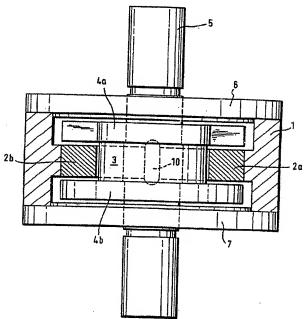
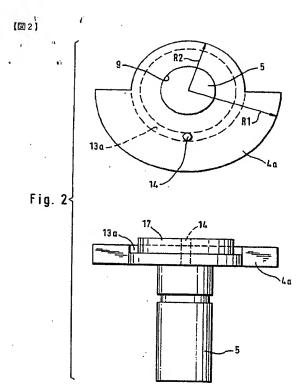
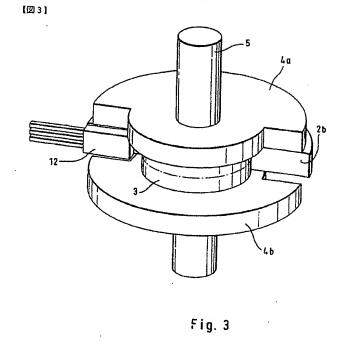
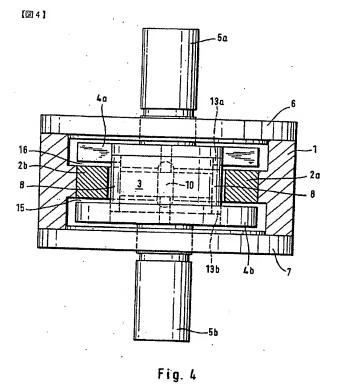
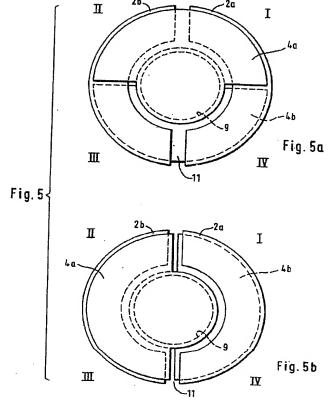


Fig. 1









【図5】

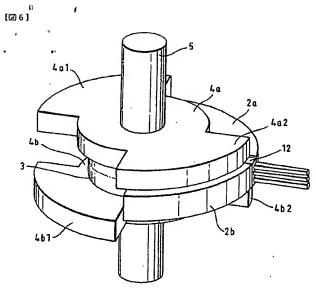


Fig. 6

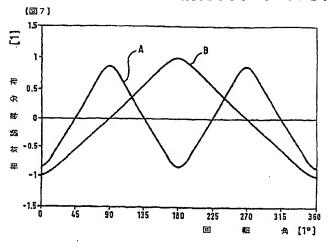
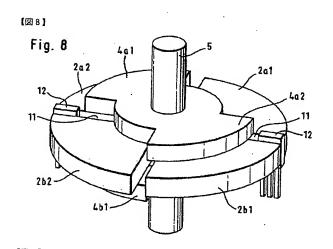
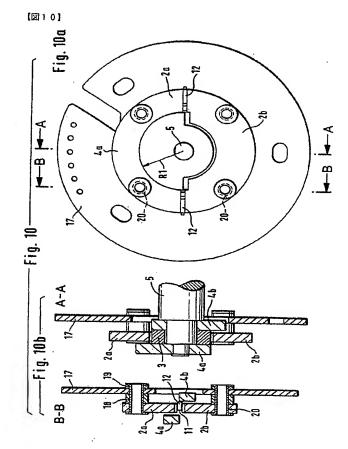
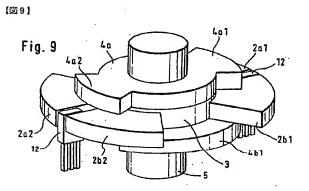
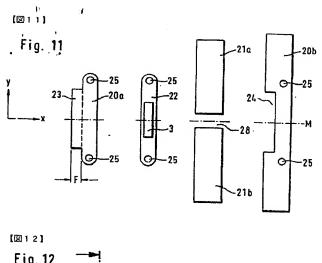


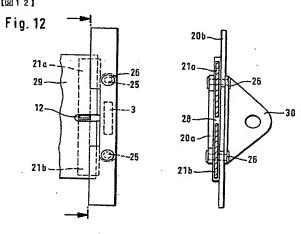
Fig. 7











フロントページの続き

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	HEPORI	tober Nonet Ac	- M M M
				plication No
4 01 400			PCI/EP 97	7/04347
IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER G01D5/14			
According (o International Patent Classification(IPC) or to both national classification	fication and IDC		
8. FIELDS	SEARCHED			
Ninimum di IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classifice $G\ 0\ I\ D$	alion symbols;		
Cocumenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are inclu	ded in the fields se	arched .
Electronic o	ata base consulted during the international search (name of data t	base and, where practical,	search terms used	
C DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category '				
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re		·	Relevant to claim No.
Y	EP 0 611 951 A (KEARNEY NATIONAL August 1994 see abstract; figures	INC) 24		1-4
Υ.	DE 43 07 544 A (SIEMENS AG) 15 S 1994 see abstract; figure 1	September		1-4
Y	WO 92 10722 A (MOVING MAGNET TEC 1992 cited in the application see abstract; figures	H) 25 June		1-4
A	FR 2 388 248 A (RADIOTECHNIQUE C 17 November 1978 see figures	OMPELEC)		1
	or documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family me	mbers are tsted in	annex,
'A" documen consider E" earlier do filing dan	Principle in an about the second	cited to understand t invention "X" document of particular cannot be considered	of the conflict with the principle or the clarific relevance; the clarific responsibilities of the	ined invention
citation	or other special reason (as specified) frefering to an oral disclosure, (so, evaluation or	"Y" document of particular cannot be considered document to combine	r relevance; the cla if to involve an inve ed with one or more	imed invention inlive step when the
P" document	t published prior to the international filing date but n the priority date dairned	ments, such combine in the art. '&" document member of	mou perud opalons	10 a person skilled
Dean of the ac	tual completion of their ternational search	Date of mailing of the		1
7	January 1998	20/01/199		
lame and ma	Furnan Pales Of the ISA	Authorized officer	"	
707	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2260 HV Ripwijk Tal. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 apo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Lloyd, P		
m PCTTISAM10	(second should be soon.	والمستحدث والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد		

INTERNATIONAL	SEARCH	DEDODT

formation on patent family members

Inter 'onel Application No PC1/EP 97/04347

	The state of the s	PC	1/EP 97/04347
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0611951 A	24-08-94	US 5444369 A JP 6249608 A	22-08-95 09-09-94
DE 4307544 A	15-09-94	NONE	
WO 9210722 A	25-06-92	FR 2670286 A DE 69123240 D DE 69123240 T EP 0514530 A US 5528139 A	12-06-92 02-01-97 05-06-97 25-11-92 18-06-96
FR 2388248 A	17-11-78	DE 2815360 A GB 1603230 A JP 1299818 C JP 53131859 A JP 60021322 B SE 7804286 A US 4204158 A	26-10-78 18-11-81 31-01-86 17-11-78 27-05-85 21-10-78 20-05-80

-11-

Form PCT/ISA/210 (patent family arriex) (July 1962)